

전고체 배터리 연구용 온간 등방압 프레스(Wip)

품목 번호: PCIH



소개

반도체 적층 공정을 위한 첨단 온간 등방압 프레스(WIP)를 만나보세요. MLCC, 하이브리드 칩, 의료용 전자 부품에 이상적입니다. 정밀한 제어로 강도와 안정성을 향상시킵니다.

자세히 알아보기

장비 모델	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
압력 범위	0-20T	0-40T	0-60.0 톤	0-100 톤
피스톤 직경	130mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	150mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	200mm (d) 크롬 도금 오일 실린더	220mm (d) 크롬 도금 오일 실린더
가압 공정	프로그램 가압 - 프로그램 유지 - 시간 제한 압력 해제			
유지 시간	1초 ~ 999분	1초 ~ 999분	1초 ~ 999분	1초 ~ 999분
압력 변환	프로그램이 샘플에 가해지는 압력을 자동으로 변환			
디스플레이	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
가열 온도	상온-200.0°C	상온-200.0°C	상온-200.0°C	상온-200.0°C
등방압	300MPa	300MPa	300MPa	500MPa
등방압 챔버 크기	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150 (M×N)	Φ50×150 (M×N)